

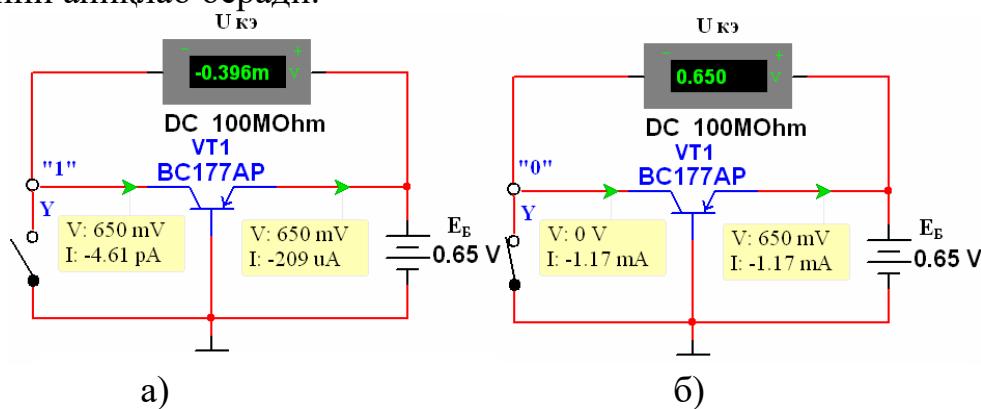
СЕКЦИЯ 6. Полупроводниковая микро- и наноэлектроника в решении проблем информационных технологий и автоматизации

ҚҮЁШ ЭЛЕМЕНТИДАН МАНБА ОЛАДИГАН МОСЛАШГАН ЭЛЕКТРОН ҚАЙТА УЛАНУВЧИ ЯЧЕЙКАЛАР Н.Б. Алимова

Ислом Каримов номидаги Тошкент давлат техника университети

Жаҳонда сўнгти вақтларда кенг ривожланаётган микроэлектроника соҳасида юқори ишчи токли, паст кучланишли, кам қувватли, барқарор параметрларга эга бўлган ахборот технологиялари ва автоматлаштириш тизимларини фото- ва инжекция-вольтаик эфектлар қўлланилиши асосидаги элементлар, тугунлар ҳамда қурилмаларин тузиш тамойиллари ва усулларини ишлаб чиқиши алоҳида аҳамият касб этади. Бу борада, ишчи токларни ошириш ва кичик қувватни истеъмолини таъминловчи кичик кучланишларни ҳосил қилиш фото- ва инжекция-вольтаик эфектлар қўлланилиши асосида ишлайдиган радиотехник элементлар ҳамда қурилмалар параметрларини турғунлигини оширишнинг янги усулларини ишлаб чиқишини талаб этади ва буларни барчаси замонавий микроэлектрониканинг асосий муаммоларидан бири ҳисобланади.

Қуёш элементларидаги фото-вольтаик эфект ҳамда кўпқатламли яримўтказличи р-п тузилмалардаги инжекция-вольтаик эфектлар орасидаги боғлиқлик назарий ўрганиб чиқилган ва электроника қурилмаларининг катта токли ва кичик кучланишли (манба кучланиши kontakt потенциаллар фарқига тенг) элемент базасини яратиш имконияти кўрсатилган [1]. Шу сабабли биполяр транзисторнинг инжекция-вольтаик режимини қўллаган ҳолда рақамли электрон қурилмалар негизи бўлган электрон қайта уланувчи ячейкалар (электрон калитлар)ни яратиш имкониятини тажрибада синаш талаб этилади. Бу эса ўз навбатида биполяр транзисторлар (масалан, кремний)да қўлланиладиган kontakt потенциаллар фарқига тенг кучланиш сатҳларида қайта уланадиган мослашган ҳолда ишлайдиган рақамли схемаларни яратиш имкони мавжудлигини аниқлаб беради.



1-расм. БТнинг инжекция-вольтаик режими: салт юриш (а), қисқа туташув (б)
холатлари

СЕКЦИЯ 6. Полупроводниковая микро- и наноэлектроника в решении проблем информационных технологий и автоматизации

Бу масала замонавий ахборот техноло-гиялари ва автоматлаштириш техникаларида мавжуд бўлган мантиқий сатхлар кучланишларининг электр қуввати истеъмолини (ва электр схемаларда иссиқ-лик қўринишида сочилишини) камайтириш мақсадида 1 В ва ундан кичик қийматларгача пасайтириш тенденцияси жиҳатидан долзарб ҳисобланади.

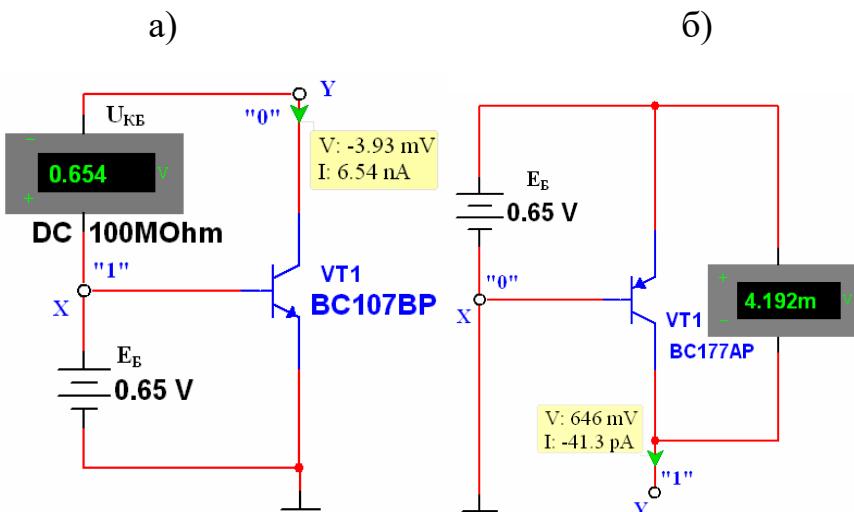
Инжекция-вольтаик режимда ишлайдиган биполяр транзисторларнинг электрон қайта уланувчи ячейкалар (электрон калитлар) яратиш имконияти тажрибада ўрганиш National Instruments компаниясининг Multisim 10.1 дастурида амалга оширилган [2]. Моделлаштириш натижалари 1-расмда келтирилган.

Кўриб ўтилган схемаларда калитни инжекция-вольтаик режимда ишлайдиган биполяр транзистор асосидаги электрон калитга алмаштириш имкони мавжуд (2-расм).

Электрон калит схемаси 2-расмда келтирилган. Электрон калит база-эмиттер оралиғи (Х кириш)га кучланиш бериш орқали бошқарилади. Агар бошқарувчи кучланиш мантиқий бир (0.65 В)га мос келса, у ҳолда бу электрон калит очиқ ҳолатда бўлади, коллектор-базадаги ИВ ЭЮК – 0.654 Вга тенг бўлади, коллектор-эмиттер ўтишдаги кучланиш (калитнинг Y чиқишидаги кучланиш) –3.93 мВга тенг бўлиб, паст сатҳ (мантиқий ноль U^0)га мос келади.

Инжекция-вольтаик режимда ЭЮК қуидаги ифодадан аниқланади [3]:

$$U_{IV, EOK} = U_{EB} \left[\left(A_K / A_E \right) + \left(A_K kT / q U_{EB} \right) \ln \left(\alpha_N I_{E0} / I_{K0} \right) \right].$$



2-расм. Электрон калитнинг очиқ (а) ва берк (б) ҳолати

Кўриниб турибди-ки электрон калитнинг назарий ҳисоблаш натижалари ва моделлаштириш натижалари мос келади (2, а ва б-расмлар).

СЕКЦИЯ 6. Полупроводниковая микро- и наноэлектроника в решении проблем информационных технологий и автоматизации

Инжекция-вольтаик режимда ишлайдиган биполяр транзисторларда бажарилган, ишчи кучланиши 0,7 В гача пасайган кичик қийматларда ишлайдиган (куёш элементидан манба оладиган), параметрлари ҳароратга турғун мантиқий элементлар асосида таклиф этилган электрон қайта уланувчи ячейкалар ахборот технологиялари ва автоматлаштириш тизимларини қувват манбайнинг ишлаш муддатини оширган.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Бустанов Х.Х., Объедков Е.В., Тошматов Ш.Т. Инжекционно-вольтаический эффект на основе многослойных полупроводниковых структурах // Ташкент, 2009. Гелиотехника, -№1. –С. 15-21.
2. Арипов Х.К., Алимова Н.Б., Бустанов Х.Х., Объедков Е.В., Тошматов Ш.Т. Адаптированные электронные переключающие ячейки с питанием от солнечного элемента // –Ташкент, 2009. Гелиотехника, -№2, 2009. –С. 8-12.
3. Арипова У.Х., Алимова Н.Б., Насырходжаев Ф.Р. Программа расчета инвертора на комплементарных биполярных транзисторах и логических элементов на его основе / Свидетельство Республики Узбекистан № DGU 02384 от 15.12.2011.

THERMAL TREATMENT OF RADIATION DEFECTS IN SILICON

Ya.A. Saidimov, R.F. Rumi, F.B. Umarov

E-mail: fajzullo.umarov.95@bk.ru

To restore the electrical properties of semiconductor materials and devices based on them after irradiation with nuclear particles, annealing of radiation defects (RD) is usually used. As a rule, annealing is understood as the thermal irreversible dissociation of a defect. In a broader sense, annealing covers the following processes: thermal dissociation of a defect; transfer of the entire marriage to the warehouse; separation of one of the components of the defect and irreversible drain; attachment of one of the components of the Frenkel pair to an existing defect [1].

The ultimate goal of studying the annealing of defects is to determine the activation energy of the annealing process and the frequency of jumps of the defect to the sink, as well as to elucidate the possible reactions of interaction between mobile and immobile defects at a given temperature. Sometimes it is also possible to determine the value of the defect destruction barrier if the pre-exponential factor v_0 is known in the expression: